



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种在医用钛或钛合金表面生成纳米管阵列氧化膜的方法

文献类型: 专利

作者 戴美林, 李述军, 郝玉琳, 杨锐 and 郭正晓

发表日期 2010-03-17

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明涉及表面处理技术领域,具体为一种在医用钛或钛合金表面生成纳米管阵列氧化膜的表面处理方法。首先通过对医用钛或钛合金表面进行预处理,然后进行阳极氧化,改变氧化电压(10-80V)和氧化时间(0.5-5h),在基体上生成直径30nm-310nm,厚度可达19 μ m的二氧化钛基氧化层,最后通过热处理,使非晶型氧化膜晶化,同时保持纳米管的完整性。此发明所用设备简易,不受基材形状的限制,可根据实际需要制备出不同直径和厚度的纳米管氧化膜。由于纳米管氧化层具有相当大的比表面积,可以增加纳米管与人体骨组织间的接触机会,利于骨组织的长入,且...

公开日期 2010-03-17

语种 中文

专利申请号 CN101671840

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/67828>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 戴美林, 李述军, 郝玉琳, 杨锐 and 郭正晓. 一种在医用钛或钛合金表面生成纳米管阵列氧化膜的方法. 2010-03-17. **GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
90	0	0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

